

Navicella Di Combustione In Ceramica Di Allumina Ad Alta Purezza Per Forni A Tubo E Sintesi Di Materiali

Numero articolo: KT-CZ



introduzione

Progettata per trattamenti termici impegnativi e deposizione da vapore, questa navicella in ceramica ad alta purezza offre una stabilità termica superiore, una completa inerzia chimica e zero contaminazione incrociata a temperature estreme, garantendo un contenimento affidabile dei campioni nella sintesi in forni a tubo, nella calcinazione e nella ricerca sui materiali avanzati.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Deposizione chimica da vapore (CVD)	Funge da supporto inerte per precursori solidi all'interno di forni a tubo di quarzo orizzontali durante la sintesi di materiali 2D, come la crescita di grafene e dicalcogenuri di metalli di transizione.	Previene la contaminazione dei precursori e fornisce tassi di generazione di vapore prevedibili attraverso superfici di evaporazione controllate.

Sintesi di batterie a stato